(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 27. November 2003 (27.11.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO~03/098206~A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: // H03H 09/145

G01N 29/02

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP03/03717

(22) Internationales Anmeldedatum:

10. April 2003 (10.04.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 22 068.9

15. Mai 2002 (15.05.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): FORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE GMBH [DE/DE]; Weberstrasse 5, 76133 Karlsruhe (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): RAPP, Michael [DE/DE]; Konrad-Adenauer-Ring 26, 69221 Eppelheim (DE). VOIGT, Achim [DE/DE]; Werderstrasse 22, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: FORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE GMBH; Stabsabteilung Marketing, Patente und Lizenzen, Postfach 36 40, 76021 Karlsruhe (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

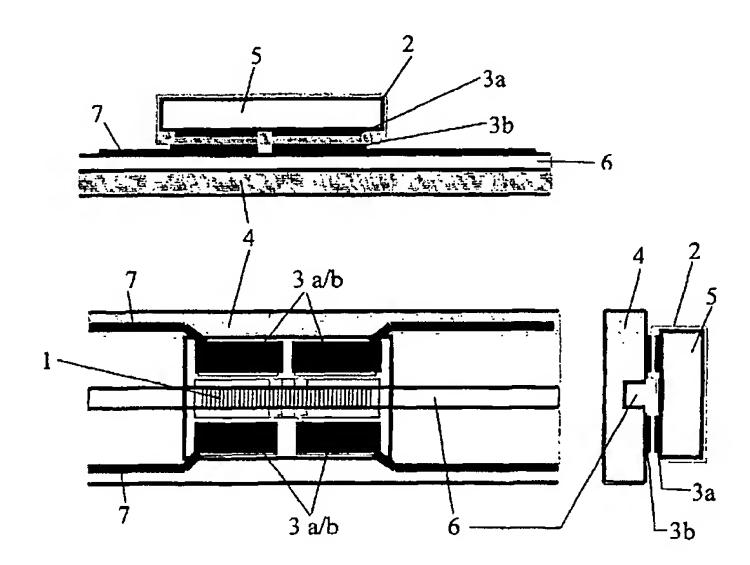
Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SENSOR BASED ON SURFACE WAVE COMPONENTS WITH CAPACITIVE COUPLING OF THE HIGH FRE-QUENCY CONNECTIONS

(54) Bezeichnung: SENSOR AUF DER BASIS VON OBERFLÄCHENWELLEN-BAUELEMENTEN MIT KAPAZITIVER KOPPLUNG DER HOCHFREQUENZANSCHLÜSSE



(57) Abstract: The invention relates to a sensor based on surface wave components, consisting of a housing comprising at least one surface wave component, one fluidic channel, and incoming and outgoing lines for the high frequency signals. The aim of the invention is to provide a sensor which is embodied in a compact and simple manner. To this end, coupling capacitors are provided, said capacitors having capacitive coupling surfaces that are applied to both the surface wave component and the housing, and enabling the incoming and outgoing lines for the high frequency signals to be established for the surface wave sensor.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

' ī

⁽⁵⁷⁾ Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Sensor auf der Basis von Oberflächenwellen-Bauelementen bestehend aus einem Gehäuse mit mindestens einem Oberflächenwellen-Bauelement, einem Fluidkanal und Zu- und Ableitungen für die Hochfrequenzsignale. Aufgabe der Erfindung ist es, den Sensor kompakt und einfach auszugestalten. Gelöst wird diese Aufgabe durch Koppelkondensatoren, deren kapazitive Koppelflächen zum einen an dem Oberflächenwellen-Bauelement und zum anderen diesen gegenüber am Gehäuse angebracht sind, mit deren Hilfe die Zu- und Ableitungen der Hochfrequenzsignale für den Oberflächenwellensensor erfolgt.

SENSOR AUF DER BASIS VON OBERFLACHENWELLEN-BAUELEMENTEN MIT KAPAZITIVER KOPPLUNG DER HOCHFREQUENZANSCHLÜSSE

Die Erfindung betrifft einen Sensor auf der Basis von Oberflächenwellen-Bauelementen nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1, wie er aus der DE 44 17 170 bekannt ist.

Im Bereich der Sensorik werden Piezoelektrische Hochfrequenzbauteile wie Bulk Schwinger, Oberflächenwellen-Resonatoren, -Verzögerungsleitungen und -Filter auf Quarz oder keramischer Basis üblicherweise über Bond oder Schweissverbindungen elektrisch kontaktiert. Diese Bonddrähte liegen oft im medienführenden Bereichen des Sensors und erzeugen ein zusätzliches Sensorrauschen durch deren Vibration, Korrossion durch unterschiedliche Materialien an der Kontaktstelle, Platzbedarf durch Bondloops und Kontakte, und Signalveschleppungen durch benötigte Bauteil Fixierungskleber.

Aus R. Steindl et. Al.: SAW Delay Lines for Wirelessly Requestable Conventional Sensors, Proc. IEEE Ultrasonic Symposium sind SAW Bau-elemente bekannt, die passiv über Transponder mit Antennen über elektromagnteische Wellen angesteuert werden.

Aus J. Freudenberg et. al.: A SAW immunosensor for operating in liquid using a SiO₂ protective layer, Sensors and Actuators B 76 (2001) 147- 151 ist ein SAW Chip bekannt, der mithilfe einer Stromschleife über Induktion gekoppelt ist. Die Realisierung der Hochfrequenzkopplung über Antennenschleifen benötigt einen großen Platzbedarf auf der Sensorchip Oberfläche. Die Ankopplung muss mechanisch präzise plaziert werden um Einfügedämfungsänderungen bei wechselndem Antennenabstand zu kompensieren. Außerdem müssen Sender und Empfängerantennen Impedanz angepaßt werden, was zu zusatzlichen Bauteilen und Einfügedämfungsänderungen führt. Das Gesamtsignal ist durch den induktiven Anteil der Antennenkopplung stark delokalisiert. Durch das große Übersprechen können somit unterschiedliche Kopplungsstrukturen nicht räumlich dicht angeordnet werden.

gung zu stellen, der kompakt und einfach aufgebaut ist.

Gelöst wird diese Aufgabe durch die Merkmale des Patentanspruchs 1. Die Unteransprüche beschreiben vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung.

Durch kapazitive Koppelflächen an dem Oberflächenwellen- Bauelement (Sensor) und der Anschluss-Grundplatte (Leiterplatte) kann die Hochfrequenz kontaktlos übertragen werden. Die Sensoroberfläche kann in gesamt mit dünnen Schutz- oder Sensorschichten versehen werden, ohne dass ohmsch kontaktiert werden muss. Des weiteren kann der fluidführende Raum in der koppelnden Leiterplatte realisiert werden womit sich sehr geringe Probevolumina ergeben.

Auf dem Sensorchip werden kapazitive Koppelflächen ausgeführt die planparallel den entsprechenden Empfängerflächen auf der Leiterplatt gegenüberliegen. Der Abstand bzw. das Dielektrikum zwischen den Koppelflächen ist durch die Sensorbeschichtung bestimmt und liegt bei einigen 100 nm.

Durch die kapazitive Ankopplung kann das System erheblich kleiner aufgebaut werden, ohne dass ein Übersprechen innerhalb eines Sensorarraysauftritt.

In der Biosensorik ist es wichtig mit geringsten Proteinmengen Sensc rik zu betreiben um die Kosten pro Analyse gering zu halten.

Der wesentliche Vorteil des erfindungsgemäßen Sensors beruht auf einer Reduktion des Probevolumens und der Vermeidung typischer Klebema terialien zur Montage üblicher SAW Bauelemente und deren Abdichtung in einer Messzelle mit polymeren Materialien. Untersuchungen haben gezeigt, dass diese für Signalverschleppungen verantwortlich sind. Alle Forderungen sind effektiv nur umsetzbar, wenn die Hochfrequenz durch eine kapazitive Kopplung erfolgt.

Der Sensor hat folgende weitere Vorteile:

Kontaktloses Ankopplung des Sensors, Sensor kann mit beliebigen Isolatoren (Polymeren) als ganzes beschichtet werden,

Mechanische Stabilität, da der Sensor auf der Leiterplatte aufliegt Möglichkeit der Fluidführung zwischen den kapazitiven Koppelflächen innerhalb der Leiterplatte,

es ist kein Fixierungskleber von gebondeten Bauteilen notwendig, Gute thermische Ankopplung an Leiterplatte,

viele Kopplungsflächen sind auf engstem Raum realisierbar.

Es wurde ein kapazitiv koppelnder Testadapter mit interner Gasführur für ein 433MHz SAW Gas Sensorarray entwickelt. Dabei wurde das Probe volumen von 1300µl auf 60µl reduziert und durch Verzicht auf Montage kleber eine wesentliche Steigerung der Signaldynamik erreicht.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels mit Hilfe der Figuren näher erläutert. Dabei zeigt die Fig. 1 schematischeinen Sensor mit Koppelkondensatoren und einer mittigen Resonatorstruktur. Die Fig. 2 zeigt eine Sensoranordnung in Schnitt Draufsicht und Seitenansicht. Die Figuren 3 und 4 zeigen die Anordnungen von 8 Sensoren auf einer Leiterplatte.

Die Fig 1 zeigt ein Oberflächenwellen- Bauelement 5 mit typischen beispielhaften Abmessungen mit 4 kapazitiven Koppelflächen 3a, mit einer mittigen Resonatorstruktur die zur Zu- und Ableitung der Hochfrequenzsignale mit diesen Koppelflächen 3a galvanisch verbunden sind. Diese Verbindungen sind im Detail nicht dargestellt.

Die Fig. 2 zeigt die Anordnung eines Sensors 5 auf der Grundplatte 4 mit Koppelflächen 3a, 3b, und Fluidkanal 6 in drei verschiedenen Ansichten. Die Grundplatte 4 enthält den Fluidkanal 6 und trägt die Leiterbahnen 7 mit den Koppelflächen 3b. Diesen gegenüber liegen die Koppelflächen 3a und der Sensor 5, wobei letztere von der Sensorbeschichtung umhüllt sind. Der mit der Grundplatte 4 gasdicht

verklebte Rahmen, der die Sensoren 5 passgenau umschliesst und die Flächendichtung die den Rahmen nach oben abdichtet sind hier nicht dargestellt.

Die Fig. 3 zeigt die Oberseite einer Trägerplatine mit einer 1mm tiefen und 1,2mm breiten vergoldeten Gaskanal Fräsung, wobei der Gaskanal 6 zweiteilig symmetrisch ausgeführt ist. Von den hier möglichen
acht Sensoren 5 ist nur einer dargestellt. Die Koppelflächen 3b für
die Masseanbindung sind hier als gemeinsame Fläche ausgeführt.

Die Fig. 4 zeigt den auf die Trägerplatine 4 zu klebender Montagerahmen für 8 SAW Sensoren 5 mit passgenauer innerer Ausfräsung und Gas-Durchführungen.

Die 8 Sensoren werden mit der sensitiven Fläche nach unten in den gasdicht aufgeklebten Rahmen eingelegt und somit über Koppelflächen platziert.

Sie werden über eine elastische Verbunddichtung aus z.B. Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) und Teflon in den Rahmen hinein und auf die Koppelflächen 3b angepresst. Dadurch erhält man eine Abdichtung der Sensoren und einen definierten Anpressdruck an die Koppelflächen der das Spaltmaß reduziert.

1	SAW	Resonatorstruktur
	- 111 <u>-</u> 111	

- 2 Sensorbeschichtung
- 3a Kapazitive Koppelflächen auf Sensoroberfläche
- 3b Kapazitive Koppelflächen auf Grundplatte
- 4 Grundplatte (Leiterplatte)
- 5 Oberflächenwellen- Bauelement (Sensor)
- 6 Fluidkanäle
- 7 Leiterbahnen auf Leiterplatte

Patentansprüche:

1. Sensor auf der Basis von Oberflächenwellen-Bauelementen bestehend aus einem Gehäuse mit mindestens einem Oberflächenwellen-Bauelement, einem Fluidkanal und Zu- und Ableitungen für die Hochfrequenzsignale, gekennzeichnet durch Koppelkondensatoren deren kapa zitive Koppelflächen (3a, 3b) zum einen an dem Oberflächenwellen-Bauelement und zum anderen diesen gegenüber am Gehäuse angebrach sind, mit deren Hilfe die Zu- und Ableitungen der Hochfrequenzsig nale für das Oberflächenwellen-Bauelement (5) erfolgt.

- 2. Sensor auf der Basis von Oberflächenwellen-Bauelementen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse aus einer Grundplatte (4) und einem Deckel besteht, wobei die Grundplatte (4) eine modifizierte Leiterplatte ist, die einen gasdicht mit ih verbundenen Rahmen zur Aufnahme von Oberflächenwellen-Bauelemente trägt, die den Fluidkanal (6) enthält, und die eine Hälfte der Koppelkondensatoren trägt.
- 3. Sensor auf der Basis von Oberflächenwellen-Bauelementen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Deckel und Grundplatte (4) eine Flächendichtung angeordnet ist wobei die Flächendichtung auf den Rahmen gepresst wird und die Oberflächenwellen-Bauelemente (5) fixiert.
- 4. Sensor auf der Basis von Oberflächenwellen-Bauelementen nach einer der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Rahmen die Oberflächenwellen-Bauelemente (5) passgenau umschließt.

5. Sensor auf der Basis von Oberflächenwellen-Bauelementen nach eine der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse acht Oberflächenwellen-Bauelemente enthält, die in zwei Gruppen a einem verzweigten Fluidkanal (6) angeordnet sind.

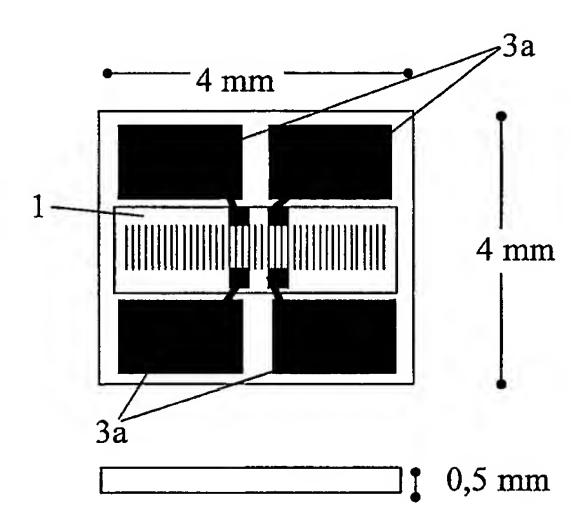


Fig. 1

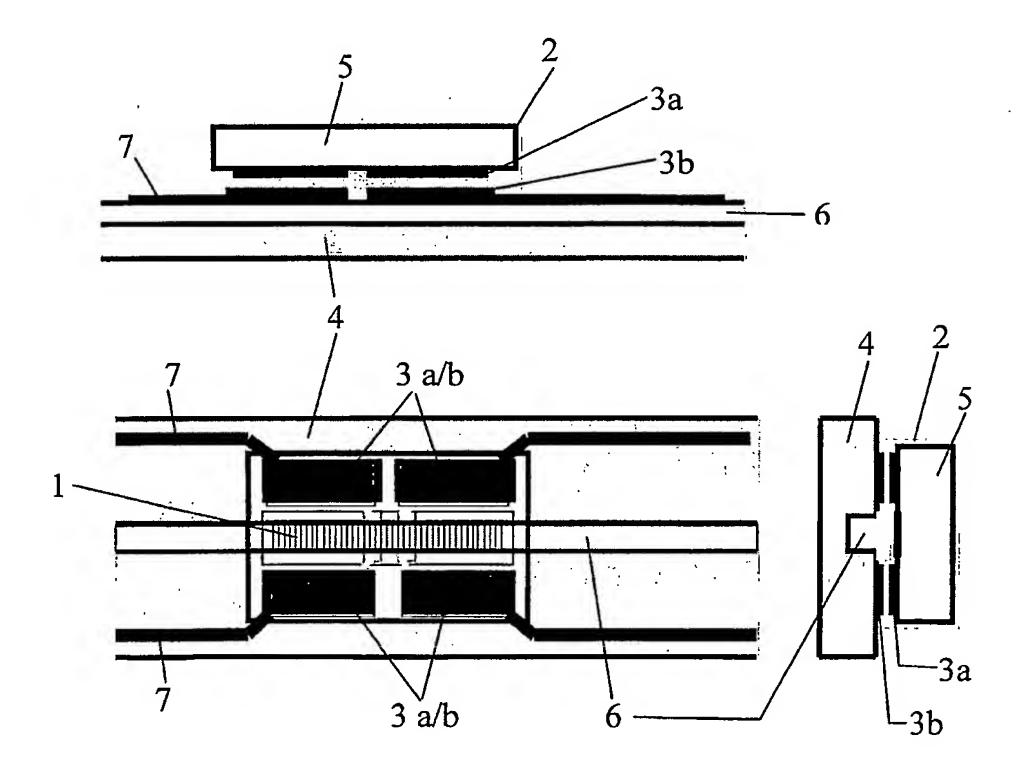


Fig. 2

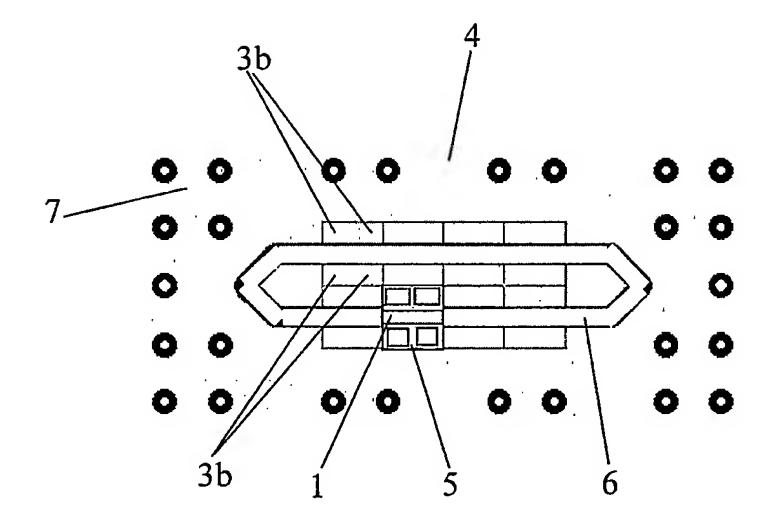


Fig. 3

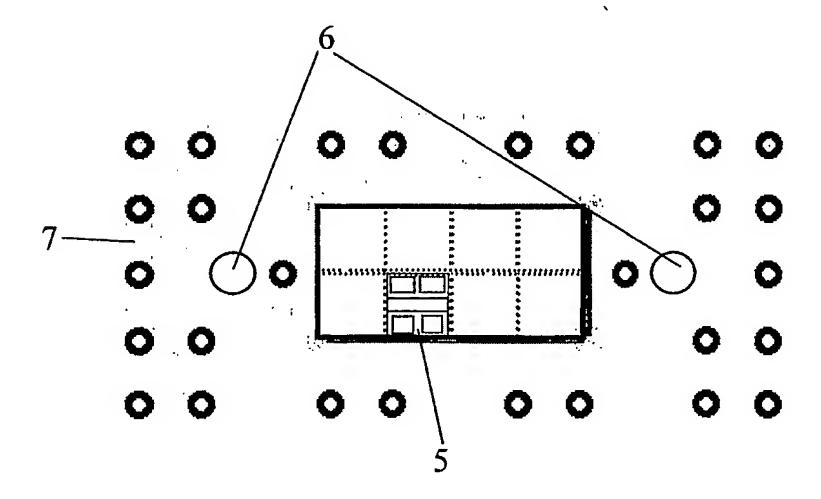


Fig. 4

IN RNATIONAL SEARCH REPORT

intermental Application No PCT/EP 03/03717

A. CLASSIF IPC 7	GO1N29/02 /HO3H9/145		,
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classificat	ion and IPC	•
B. FIELDS			
Minimum do	cumentation searched (classification system followed by classification GO1N HO3H	n symbols)	
Documentati	ion searched other than minimum documentation to the extent that su	ch documents are included in the fields sea	rched
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data bas	e and, where practical, search terms used)	
EPO-In	ternal, PAJ		
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vant passages	Relevant to claim No.
Χ	WO 01 61336 A (FISCHERAUER GERHAR ULRICH (DE); SIEMENS AG (DE); ZOT	D ;KNAUER TL HE)	1
А	23 August 2001 (2001-08-23) abstract; claims 1,8; figures 1-3 page 1, line 5 -page 8, line 25		2-5
		./	
		ĺ	
 	•		
<u> </u>			
			• •
	·		
X Fur	ther documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed i	n annex.
° Special c	ategories of cited documents :	"T" later document published after the inter	national filing date
'A' docum	nent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with to cited to understand the principle or the invention	eory underlying the
'E' earlier	document but published on or after the international	*X* document of particular relevance: the ci	laimed Invention
filing "L" docum	ent which may throw doubts on priority claim(s) or	cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the doc	cument is taken alone
citatio	n is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the cleannot be considered to involve an involve an involve and document is combined with one or mo	entive step when the
other	nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	ments, such combination being obvious in the art.	
'P' docum	nent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	*&* document member of the same patent t	
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	arch report
	13 August 2003	26/08/2003	
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Uttenthaler, E	

and a section of the section of

IN RNATIONAL SEARCH REPORT

Intermonal Application No
PCT/EP 03/03717

	PCT/EP 03/03717			
C.(Continua	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category •	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Y	FREUDENBERG J ET AL: "A SAW immunosensor for operation in liquid using a SiO2 protective layer" SENSORS AND ACTUATORS B, ELSEVIER SEQUOIA S.A., LAUSANNE, CH, vol. 76, no. 1-3, 1 June 2001 (2001-06-01), pages 147-151, XPO04241108 ISSN: 0925-4005	1		
A	cited in the application abstract; figures 2,3 page 147, left-hand column, paragraph 1 -page 149, left-hand column, paragraph 1	2-5		
Y	DE 196 19 311 A (SIEMENS AG) 12 December 1996 (1996-12-12) abstract; claim 1 column 1, line 3 -column 3, line 30	1		
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 11, 3 January 2001 (2001-01-03) & JP 2000 223989 A (KYOCERA CORP), 11 August 2000 (2000-08-11) abstract			
•		•		

IN RNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Interior and Application No
PCT/EP 03/03717

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 0161336	A	23-08-2001	WO	0161336 A1	23-08-2001
DE 19619311	<u></u>	12-12-1996	DE	29509278 U1	. 16-11-1995
DE 19012011	, •		DE	19619311 A1	12-12-1996
			AT	175781 T	15-01-1999
			AU	701577 B2	04-02-1999
			AU	5811296 A	24-12-1996
			WO	9639639 A1	12-12-1996
			DE	59601154 D1	25-02-1999
			EP	0830617 A1	25-03-1998
			TW	476191 B	11-02-2002
JP 2000223989	Α	11-08-2000	NONE		

INTERNATIONA RECHERCHENBERICHT

Inter onales Aktenzelchen
PCT/EP 03/03717

a. Klassifii IPK 7	ZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G01N29/02 //H03H9/145		
	rnationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifik	cation und der IPK	
Recherchierte IPK 7	er Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) GOIN HO3H		
Recherchierte	e aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sowei	t diese unter die recherchierten Gebiete f	allen
Mahand dor	internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Nam	e der Datenbank und evtl. verwendete S	uchbegriffe)
	ernal, PAJ		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe d	er in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Χ	WO 01 61336 A (FISCHERAUER GERHARD ULRICH (DE); SIEMENS AG (DE); ZOTT	;KNAUER L HE)	1
Α	23. August 2001 (2001-08-23) Zusammenfassung; Ansprüche 1,8; Abbildungen 1-3 Seite 1, Zeile 5 -Seite 8, Zeile 2		2-5
	eitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	X Siehe Anhang Patentfamille	
"Besonde "A" Veröff aber "E" ällerc Anm "L" Veröff sche ande soll ausg "O" Verö	fentlichung, die den allgemeinen Stand der Fechtik Gehinen, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist is Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen seldedatum veröffentlicht worden ist ist fentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erzeinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie geführt) ffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,	werden, wenn die Veröffentlichung n Veröffentlichungen dieser Kategorie diese Verbindung für einen Fachmar *&" Veröffentlichung, die Mitglied derselb	eutung; die beanspruchte Erfindun lichung nicht als neu oder auf rachtet werden eutung; die beanspruchte Erfindun eutung; die beanspruchte Erfindun gkelt beruhend betrachtet nit einer oder mehreren anderen in Verbindung gebracht wird und en Patentfamilie ist
Datum de	es Abschlusses der Internationalen Recherche 13. August 2003	Absendedatum des internationalen F	acherollendenolle
Name un	d Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevollmächtigter Bediensteter Uttenthaler, E	

INTERNATIONA RECHERCHENBERICHT

Interior Snales Aktenzelchen
PCT/EP 03/03717

	PC	T/EP 03/03717					
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	ICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
Categorie°	Bezelchnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden	Teile Betr. Anspruch Nr.					
	FREUDENBERG J ET AL: "A SAW immunosensor for operation in liquid using a SiO2 protective layer" SENSORS AND ACTUATORS B, ELSEVIER SEQUOIA S.A., LAUSANNE, CH, Bd. 76, Nr. 1-3, 1. Juni 2001 (2001-06-01), Seiten 147-151, XP004241108 ISSN: 0925-4005 in der Anmeldung erwähnt						
Α	Zusammenfassung; Abbildungen 2,3 Seite 147, linke Spalte, Absatz 1 -Seite 149, linke Spalte, Absatz 1	2–5					
Y	DE 196 19 311 A (SIEMENS AG) 12. Dezember 1996 (1996-12-12) Zusammenfassung; Anspruch 1 Spalte 1, Zeile 3 -Spalte 3, Zeile 30	1					
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 11, 3. Januar 2001 (2001-01-03) & JP 2000 223989 A (KYOCERA CORP), 11. August 2000 (2000-08-11) Zusammenfassung						

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patenttamilie gehören

Internale	es Aktenzelchen
PCT/EP	03/03717

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung			Datum der Veröffentlichung	
WO 0161336	A	23-08-2001	WO	0161336 A1	23-08-2001	
DE 19619311	A	12-12-1996	DE DE AT AU AU WO DE EP TW	29509278 U1 19619311 A1 175781 T 701577 B2 5811296 A 9639639 A1 59601154 D1 0830617 A1 476191 B	16-11-1995 12-12-1996 15-01-1999 04-02-1999 24-12-1996 12-12-1996 25-02-1999 25-03-1998 11-02-2002	
JP 2000223989	A	11-08-2000	KEINE			